PAT-NO:

9)

JP02004273946A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2004273946 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

September 30, 2004

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY FUKATSU, AKIHIRO N/A SAITO, MITSUHIRO N/A KIUCHI, HIROSHI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME DENSO CORP COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP2003065537

APPL-DATE:

March 11, 2003

INT-CL (IPC): H01L023/13, H01L023/12, H01L023/50

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent disconnection of a wire by preventing

protrusion of an adhesive in a semiconductor device whereon a semiconductor

element is mounted via the adhesive on a lead frame.

SOLUTION: A projection 17 (an adhesive protrusion prevention means mentioned

in this invention) is provided to an outer circumferential part of a surface of

an alumina substrate 11 mounted on a lead frame 12. By such a constitution,

since the adhesive 14 is prevented from protruding to an outer circumferential

part outside the projection 17 when the alumina substrate 11 is mounted on the

lead frame 12, the adhesive 14 can be prevented from flowing to a surface

whereon a power <u>chip</u> 11a and a <u>chip</u> capacitor 11b are mounted in the alumina substrate 11. As a result, peeling of a mold <u>resin</u> 6 and disconnection of <u>wires</u> 15a, 15b can be prevented even if a cold cycle is added to a <u>resin</u> sealed semiconductor device 20.

COPYRIGHT: (C) 2004, JPO&NCIPI

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-273946 (P2004-273946A)

(43) 公開日 平成16年9月30日(2004.9.30)

(51) Int.C1. ⁷	Fi		テーマコード (参考)
HO1L 23/13	HO1L 23/12	C	5F067
HO1L 23/12	HO1L 23/50	Ü	
HO1L 23/50	HO1L 23/12	В	•

審査請求 未請求 請求項の数 5 〇L (全8頁)

(21) 出願番号	特願2003-65537 (P2003-65537)	(71) 出願人	000004260
(22) 出願日	平成15年3月11日 (2003.3.11)		株式会社デンソー
			愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
		(74) 代理人	100096998
			弁理士 碓氷 裕彦
		(74) 代理人	100118197
			弁理士 加藤 大登
		(74) 代理人	100123191
			弁理士 伊藤 髙順
		(72) 発明者	深津 明弘
			愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
			社デンソー内
		(72) 発明者	斎藤 光弘
			愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
			社デンソー内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】半導体装置

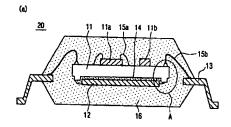
(57)【要約】

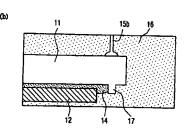
【課題】リードフレーム上に接着剤を介して半導体素子が実装された半導体装置において、接着剤のはみだしを 防止することにより、ワイヤの断線を防止すること。

【解決手段】本発明では、アルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面の外周部には突起17(本発明で言う、接着剤はみだし防止手段)が設けられていることを特徴としている。このような構成にしたことにより、リードフレーム12にアルミナ基板11を搭載した際に、接着剤14が突起17よりも外周部にはみだすことを防止することができるため、接着剤14がアルミナ基板11におけるパワーチップ11aやチップコンデンサ11bが搭載された面に流れてしまうことを防止することができる。その結果、樹脂封止型半導体装置20に冷熱サイクルが加わわったとしても、モールド樹脂6の剥離及びワイヤ15a、15bの断線を防止することができる。

【選択図】

図 1





【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体素子と、

一面側に接着剤を介して前記半導体素子が搭載されたリードフレームと、

前記半導体素子と前記リードフレームとを電気的に接続するワイヤと

を備えた半導体装置において、

前記半導体素子における前記リードフレームと対向する面または前記リードフレームにおける前記半導体素子と対向する面の少なくともどちらか一方には、前記接着剤のはみだしを防止する接着剤はみだし防止手段が設けられていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

前記接着剤はみだし防止手段として、前記半導体素子における前記リードフレームと対向する面または前記リードフレームにおける前記半導体素子と対向する面の少なくともどちらか一方に突起を設けたことを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。.

【請求項3】

前記接着剤はみだし防止手段として、前記半導体素子における前記リードフレームと対向する面または前記リードフレームにおける前記半導体素子と対向する面の少なくともどちらか一方に溝を設けたことを特徴とする請求項1または2に記載の半導体装置。

【請求項4】

前記接着剤はみだし防止手段として、前記半導体素子における前記リードフレームと対向する面または前記リードフレームにおける前記半導体素子と対向する面の少なくともどちらか一方に、前記接着剤が塗布される領域を囲むようにダムを設けたことを特徴とする請求項1乃至3の何れか1つに記載の半導体装置。

【請求項5】

請求項1乃至4の何れか1つに記載の半導体装置は、前記半導体素子、前記リードフレーム及び前記ワイヤがモールド樹脂にて封止してなる封止樹脂型半導体装置であることを特徴とする。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、リードフレーム上に接着剤を介して半導体素子が実装された半導体装置に関し 30 、特にその接着剤のはみだしを防止した構造に関する。

[0002]

【従来技術】

この種の半導体装置としては、図4に示されるように、半導体素子1を接着剤4を介してリードフレーム2上に搭載し、さらに、この半導体素子1の表面に形成されたアルミニウム電極(図示せず)とリードピン3との間を、ワイヤ5にて電気的に接続した半導体装置をモールド樹脂6にて封止した樹脂封止型半導体装置10がある(例えば、特許文献1参照)。

[0003]

【特許文献1】

40

10

20

特開平10-114853号公報(第11頁右欄48行-第12頁左欄4行、図1)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、本発明者等の検討によれば、上記特許文献では、予め接着剤 4 が塗布されたリードフレーム 2 上に半導体素子 1 を搭載する際に、リードフレーム 2 と半導体素子 1 との接触面から接着剤 4 がはみだしてしまう恐れがあることがわかった。

[0005]

その結果、樹脂封止型半導体装置10に冷熱サイクルが加わることで、はみだした接着剤 4の膨張により熱応力が発生し、この熱応力によりモールド樹脂6が剥離してしまい、こ の剥離によりワイヤ5に応力が加わり、ワイヤ5が断線してしまうという問題がある。

[0006]

また、上記特許文献では、半導体装置をモールド樹脂6にて封止した樹脂封止型半導体装置について説明しているが、モールド樹脂にて封止されていない半導体装置においても、はみだした接着剤がワイヤに接触すると、熱応力によりワイヤが断線してしまうという問題がある。なお、このような問題点は、リードフレーム上に回路基板を搭載し、この回路基板上に複数の半導体素子を搭載した混成集積回路装置においても発生する。

[0007]

そこで、本発明の目的は、上記問題点に鑑み、リードフレーム上に接着剤を介して半導体素子が実装された半導体装置において、接着剤のはみだしを防止することにより、ワイヤの断線を防止することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の半導体装置は、半導体素子と、一面側に接着剤を介して前記半導体素子が搭載されたリードフレームと、前記半導体素子と前記リードフレームとを電気的に接続するワイヤとを備え、前記半導体素子、前記リードフレーム及び前記ワイヤを包み込むように封止してなる半導体装置において、前記半導体素子における前記リードフレームと対向する面または前記リードフレームにおける前記半導体素子と対向する面の少なくともどちらか一方には、前記接着剤のはみだしを防止する接着剤はみだし防止手段が設けられていることを特徴としている。

[0009]

請求項1に記載の発明によれば、半導体素子におけるリードフレームと対向する面または リードフレームにおける半導体素子と対向する面の少なくともどちらか一方には、接着剤 のはみだしを防止する接着剤はみだし防止手段が設けられているため、リードフレームと 半導体素子との接触面から接着剤がはみだしてしまうことを防止することができる。

[0010]

具体的には、請求項2に記載のように突起を設けたり、請求項3に記載のように溝を設けたり、請求項3に記載のようにダムを設けたりすることにより、請求項1に記載の接着剤はみだし防止手段を実現することができる。

[0011]

また、請求項5に記載のように、半導体素子、リードフレーム及びワイヤがモールド樹脂にて封止してなる封止樹脂型半導体装置において、請求項1乃至4に記載の発明を適用すると、より大きな効果を得ることができる。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下、この発明を具体化した各実施形態を図面に従って説明する。

[0013]

(第1実施形態)

図 1 (a) に本発明の第 1 実施形態に係る樹脂封止型半導体装置 2 0 の断面構造を示し、図 1 (b) に図 1 (a) における A 部拡大図を示す。

[0014]

[0015]

パワーチップ11は、アルミナ基板11上に形成された電極パッド(図示せず)と、ワイヤボンディングによるワイヤ15aにて電気的に接続されている。

[0016]

50

40

10

そして、パワーチップ11aやチップコンデンサ11bが搭載されたアルミナ基板11は、銅(Cu)からなるリードフレーム12に、シリコーンゴム等からなる接着剤14を介して接合されている。

[0017]

また、アルミナ基板11におけるパワーチップ11aやチップコンデンサ11bが搭載された面には電極パッド(図示せず)が形成されており、この電極パッドとリードピン13とは、ワイヤボンディングによるワイヤ15bにて電気的に接続されている。

[0018]

そして、リードフレーム12及びアルミナ基板11の全体は、エポキシ系樹脂等からなる 便質の封止樹脂16によりモールド封止されている。なお、この封止樹脂17の熱膨張率 は、約10ppmである。

[0019]

ここで、本発明では、図1(a)におけるA部拡大図である図1(b)に示されるように、アルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面の外周部には突起17(本発明で言う、接着剤はみだし防止手段)が設けられていることを特徴としている。なお、この突起17は、アルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面の外周部に環状に設けられており、例えば、プレス加工等により、リードフレーム12に搭載される前に予め形成されている。

[0020]

このような構成にしたことにより、リードフレーム12にアルミナ基板11を搭載した際に、接着剤14が突起17よりも外周部にはみだすことを防止することができるため、接着剤14がアルミナ基板11におけるパワーチップ11aやチップコンデンサ11bが搭載された面に流れてしまうことを防止することができる。

[0021]

その結果、樹脂封止型半導体装置 2 0 に冷熱サイクルが加わわったとしても、モールド樹脂 6 の剥離及びワイヤ 1 5 a、 1 5 b の断線を防止することができる。

[0022]

(第2実施形態)

図 2 (a) に本発明の第 2 実施形態に係る樹脂封止型半導体装置 2 0 の断面構造を示し、図 2 (b) に図 2 (a) における B 部拡大図を示す。

[0023]

本実施形態の半導体装置の構成は、上記第1実施形態とほぼ同様であるため、第1実施形態と同等な構成については同様の符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。

[0024]

上記第1実施形態では、アルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面の外周部に突起17を設けたことを特徴としているが、本実施形態では、図2(a)におけるB部拡大図である図2(b)に示されるように、アルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面の外周部に、溝18(本発明で言う、接着剤はみだし防止手段)を設けたことを特徴としている。なお、この溝18は、上記突起17と同様に、アルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面の外周部に環状に設けられており、例えば、プレス加工等により、リードフレーム12に搭載される前に予め形成されている

[0025]

このような構成にしたことにより、上記第1実施形態と同様の効果を得ることができる。 【0026】

(第3実施形態)

図3(a)に本発明の第3実施形態に係る樹脂封止型半導体装置20の断面構造を示し、図3(b)に図3(a)におけるC部拡大図を示す。

[0027]

本実施形態の半導体装置の構成は、上記第1実施形態とほぼ同様であるため、第1実施形

50

10

30

態と同等な構成については同様の符号を付し、異なる部分についてのみ説明する。

[0028]

上記第1実施形態では、アルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面の外周部に突起17を設けたことを特徴としているが、本実施形態では、図3(a)におけるC部拡大図である図3(b)に示されるように、リードフレーム12におけるアルミナ基板11が搭載される面の外周部に、接着剤4が塗布される領域を囲むようにダム19a(本発明で言う、接着剤はみだし防止手段)を設けたことを特徴としている。なお、このダム19aは、リードフレーム12におけるアルミナ基板11が搭載される面の外周部に環状に設けられており、例えば、プレス加工等により、アルミナ基板11が搭載される前に予め形成されている。

[0029]

このような構成にしたことにより、上記第1実施形態と同様の効果を得ることができる。また、このように接着剤4が塗布される領域を囲むようにダム19aを設けた場合、ダム19aの内部には、接着剤4の厚みを確保し、アルミナ基板11とリードフレーム12との密着力を確保する目的で、突起19bを設けると好ましい。

[0030]

尚、本発明は、上記各実施形態に限られるものではなく、様々な態様に適用可能である。 【0031】

例えば、上記第1実施形態では、接着剤4のはみだしを防止する突起17をアルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面に設けた構造について説明したが、これに限られるものではなく、接着剤4のはみだしを防止する突起17を、リードフレーム12におけるアルミナ基板11が搭載される面に設けてもよい。

[0032]

また、上記第2実施形態では、接着剤4のはみだしを防止する溝18をアルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面に設けた構造について説明したが、これに限られるものではなく、接着剤4のはみだしを防止する溝18を、リードフレーム12におけるアルミナ基板11が搭載される面に設けてもよい。

[0033]

また、上記第3実施形態では、接着剤4のはみだしを防止するダム19aをリードフレーム12におけるアルミナ基板11が搭載される面に設けた構造について説明したが、これに限られるものではなく、接着剤4のはみだしを防止する溝18を、アルミナ基板11におけるリードフレーム12に搭載される面に設けてもよい。

[0034]

また、上記第3実施形態では、ダム19aをリードフレーム12におけるアルミナ基板1 1が搭載される面の外周部に環状に設けているが、これに限られるものではなく、例えば、リードフレーム12におけるアルミナ基板11が搭載される面の四隅にダムを設けてもよい。

[0035]

また、上記第1乃至3実施形態では、接着剤はみだし手段としての、突起17、溝18及びダム19aを1つのみ設けた構造について説明したが、これに限られるものではなく、 突起17、溝18及びダム19aを複数設けてもよい。

[0036]

また、上記第1乃至3実施形態では、接着剤はみだし手段としての、突起17、溝18及びダム19aを個々に設けた構造について説明したが、これに限られるものではなく、突起17、溝18及びダム19aを混同として設けてもよい。

[0037]

また、上記第1乃至3実施形態では、アルミナ基板11上に複数の半導体素子が搭載された混成集積回路装置について説明したが、これに限られるものではなく、例えば、アルミナ基板11上に1つの半導体素子が搭載された構造であってもよく、リードフレーム12上にアルミナ基板11を介さずに半導体素子が直接搭載された構造であってもよい。

10

50

[0038]

また、上記第1乃至3実施形態では、アルミナ基板11の水平方向における長さよりもリードフレーム12の水平方向における長さが短い構造について説明したが、これに限られるものではなく、アルミナ基板11の水平方向における長さとリードフレーム12の水平方向における長さとが同じである構造であってもよく、アルミナ基板11の水平方向における長さが短い構造でもよい。

[0039]

また、上記第1乃至3実施形態では、接着剤はみだし手段としての、突起17、溝18及びダム19aをプレス加工により形成した構造について説明したが、これに限られるものではなく、例えば、アルミナ基板11を用意して、樹脂等の別部材を配設することにより、突起17、溝18及びダム19aを形成してもよい。

[0040]

また、上記第3実施形態では、リードフレーム12におけるダム19aが形成された部位を除く部位は、アルミナ基板11と非接触の構造となっているが、これに限られるものではなく、リードフレーム12におけるダム19aが形成された部位を除く部位は、アルミナ基板11と接触していてもよい。

[0041]

また、上記第1乃至3実施形態では、リードフレーム12及びアルミナ基板11の全体が封止樹脂16によりモールド封止された樹脂封止型半導体装置について説明したが、これに限られるものではなく、封止樹脂によりモールド封止されていない半導体装置においては、はみだした接着剤がワイヤに接触した場合にのみ、ワイヤの断線という問題が発生する。これに対して、封止樹脂16によりモールド封止された樹脂封止型半導体装置においては、上述のように、はみだした接着剤14がワイヤ15a、15bに接触しなくともワイヤ15a、15bの断線という問題が発生する。従って、本発明を樹脂封止型半導体装置に適用すると、より大きな効果を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】(a)は本発明の第1実施形態に係る樹脂封止型半導体装置の断面構造を示す図であり、(b)は(a)におけるA部拡大図を示す図である。
- 【図2】 (a) は本発明の第2実施形態に係る樹脂封止型半導体装置の断面構造を示す図 30 であり、(b) は (a) におけるB部拡大図を示す図である。
- 【図3】(a)は本発明の第3実施形態に係る樹脂封止型半導体装置の断面構造を示す図であり、(b)は(a)におけるC部拡大図を示す図である。
- 【図4】従来の樹脂封止型半導体装置の断面構造を説明する断面図である。

【符号の説明】

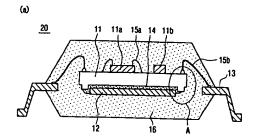
- 11…アルミナ基板、
- 11a…パワーチップ、
- 111 ...チップコンデンサ、
- 12…リードフレーム、
- 13…リードピン、
- 1 4 … 接着剤、
- 15a、15b…ワイヤ、
- 1 6. … 封止樹脂、
- 17…突起、
- 18…溝、
- 19a…ダム、
- 19b…突起、
- 20…樹脂封止型半導体装置。

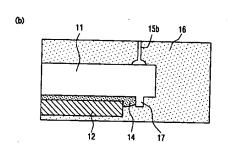
40

10

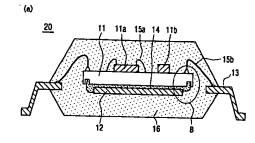
\$@BB@□8@ ~V•\$ +M□•X□■B B@□@©@@

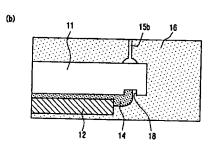
[図1]



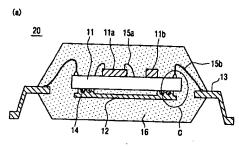


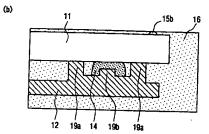
[図2]



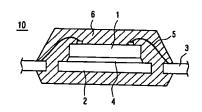


【図3】





【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 木内 寛 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内 Fターム(参考) 5F067 BB08 BE02 BE10 CC09 DA05